

小型精密加湿装置

Model me-40DP

Model me-40DP は、一定温度の試験空間における湿度環境試験専用機です。飽和槽温度をペルチェ素子による冷却を行うことにより従来にない小型軽量化を実現した小型調湿発生器です。

空調的な作業環境の調湿というより、小空間の精密な湿度制御に最適です。応答性を重視し、精密な調湿を必要とする開発技術者、研究者にお勧めです。



主な用途

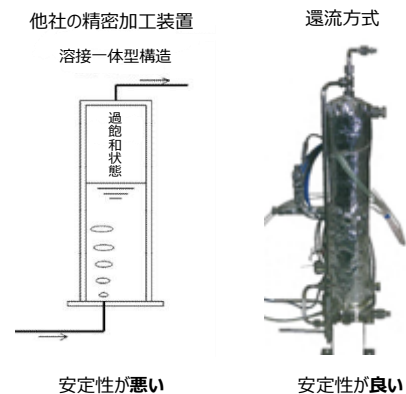
- 燃料電池の評価試験
- 分析機器内の湿度調整用、校正用
- 反応ガス中の水分添加
- 触媒開発用途 試験槽に水分添加
- 研究開発用途 試験槽に水分添加
- 湿度計校正 相対湿度 5~100%
- 炉内水分管理 焼成炉、メッキ炉他
- 光合成試験 植物の蛍光特性

特徴

- ペルチェ素子による冷却システム
- 高精度・高安定性
- 高応答性
- 小型軽量化

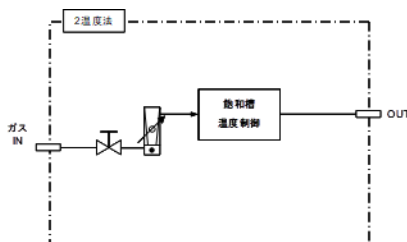
動作原理

- ペルチェ素子による冷却システムより、従来よりも装置のサイズを小型し、軽量化を実現しています。また高速で湿度コントロールすることも可能な為、研究用途や分析機器の校正等、幅広くお使いいただけます。
- 2温度法に基づく独自の還流方式の飽和槽により発生ガスの露点がバブラーの水温に等しくなるという基本原理を忠実に再現し、高精度の加湿ガスを供給することができます。



装置フロー

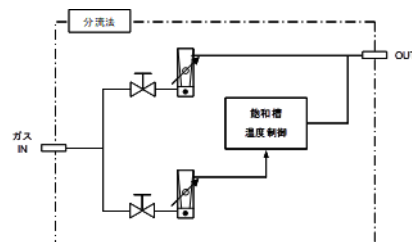
■ 標準型、加圧型、露点拡張型



飽和槽の水温と一致した露点のガスになります。

面積式流量計が1台付属します。(流量調整用ニードルバルブ付)

■ 分流型モデル



飽和槽ラインにドライガスを混ぜる事により、露点を下げます。

面積式流量計が2台付属します。装置フロー図をご参照ください。

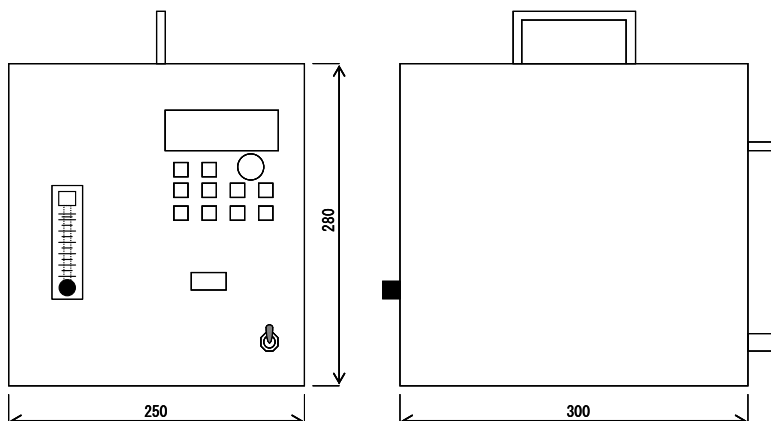
オプション

本シリーズには様々なオプションのご用意があります。
詳しくは当社営業にお尋ねください。

参考例：ホットホース
PC 制御
お客様ご要望に合わせた制御・通信



外形図



湿度校正器 HUM
湿度計校正用の試験槽が装置上部に設置してあります。

技術仕様

本体仕様

制御方式	2 温度法もしくは分流法によるバブリング方式
飽和槽温度	+2 ~+90 °C (シリーズによる)
発生露点範囲	+2 ~+90 °Cdp (シリーズによる)
加湿精度	±0.3 °Cdp
加湿安定性	±0.1°C (分流型は±0.5°C)
流量制御	面積式流量計 (オプション：マスフローコントローラー)
加湿流量	最大 2L/min (標準品) ~ (シリーズによる)
給 水	手動給水 オプションで、給水ポンプ内蔵による自動給水
外部出力	USB ポート標準装備 オプションで、オペレーションソフト&ノート PC
装置寸法	W270×H330×D350 ~
装置重量	8.5kg~
電 源	AC100V 50/60Hz

本カタログは予告なく変更する場合があります。
2024/04 版数 1

株式会社テクネ計測

□本社 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子 6-14-10
TEL: 044-379-3697 FAX: 044-379-4105
□大阪 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満 2-9-4
TEL: 06-6809-6565 FAX: 06-6809-6566
□福岡 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-11-27
TEL: 092-477-7330 FAX: 092-477-7331
URL: <https://www.tekhne.co.jp> Mail: info@tekhne.co.jp